

СОДЕРЖАНИЕ

Материалы XIV Международной конференции "Взаимодействие ионов с поверхностью"

Смирнов В.К., Кибалов Д.С., Лепшин П.А., Бачурин В.И. Влияние топографических неоднородностей на процесс образования волнообразного микрорельефа на поверхности кремния	626
Глазов Л.Г. Ограниченная среда: аналитическая теория каскадов столкновений и распыления	631
Куликаускас В.С., Машкова Е.С., Молчанов В.А., Хайдаров А.А., Черныш В.С., Экштайн В. Механизмы распыления платины ионами инертных газов	639
Беграмбеков Л.Б., Боброва Н.С., Сидоров С.А., Усов В.М. Влияние перенапыления на рост конических образований на поверхности металла при ионном облучении.....	645
Мосунов А.С., Мосунова Н.А. Зависимость параметров распыления от энергии связи	648
Войцеховский И.А., Медведева М.В., Ферлергер В.Х., Брюнинг К., Хайланд В. Уширение энергетических спектров атомов, рассеянных поверхностью твердого тела при молекулярной бомбардировке	653
Кортенраад Р., Дениер ван дер Гон А.В., Бронгерсма Х.Х., Гартнер Г., Маненсхайн А., Ермолов С.Н., Глебовский В.Г. Исследование термоэмиссионных катодов с малой работой выхода методом рассеяния медленных ионов	658
Матулевич Ю.Т., Хрустачев И.К., Миннебаев К.Ф., Уразгильдин И.Ф., Юрасова В.Е. Кинетическая вторичная ионная эмиссия кремния	665
Филимонов А.В., Петров Н.Н., Королева Е.Ю., Кораблев В.В. Механизм эмиссии двухзарядных ионов	672
Теплова Я.А., Дмитриев И.С., Белкова Ю.А. Влияние плотности среды на сечения перезарядки быстрых тяжелых ионов	677
Зейлманс ван Эммиховен П.А., Ван Сомерен Б., Уразгильдин И.Ф., Нишаус А. Возбуждение плазмонов в твердых телах ионами с подпороговой скоростью	682
Керков Х., Штолле Р., Петухов В.П., Романовский Е.А. Эмиссия электронов из пленок углерода и золота в процессе бомбардировки ионами	686
Кортенраад Р., Ермолов С.Н., Дениер ван дер Гон А.В., Семенов В.Н., Бронгерсма Х.Х., Глебовский В.Г., Божко С.И. Исследования высокочистых монокристаллов вольфрама методами рассеяния медленных ионов, оже-спектроскопии, дифракции медленных электронов и рентгеновской дифракции	691
Грицына В.В., Коваль А.Г., Гоков С.П., Шевченко Д.И. Сравнение основных характеристик ионно-фотонной эмиссии переходных и непереходных металлов и их соединений	698
Лай Синьчунь, Пушкин М.А., Борман В.Д., Зенкевич А.В., Лебединский Ю.Ю., Неволин В.Н., Тронин В.Н., Троян В.И. Особенности взаимодействия атомов Au с поверхностью NaCl(100) при импульсном лазерном осаждении	702
Корнич Г.В., Бетц Г., Бажин А.И. Двухэтапное моделирование ионного перемешивания примесных профилей низкой концентрации	709
Аброян И.А., Бобров А.В., Никулина Л.М. Об одной особенности молекулярного эффекта в кремни для легких ионов	716
Барабаненков М.Ю., Леонов А.В., Мордкович В.Н., Омельяновская Н.М. Зависимость дефектообразования в <i>n</i> -Si от массы ионов и интенсивности фотовозбуждения при низкодозовой ионной имплантации	721
Тетьельбаум Д.И., Курильчик Е.В., Доценко Е.Е., Разин И.А., Азов А.Ю. О механизме малодозового эффекта дальнодействия	726
Шаралов В.М. Влияние низкоэнергетического ионного облучения на десорбционные процессы в проникновении водорода сквозь металлы	732
Борисов А.М., Крит Б.Л., Тихонов С.А., Суминов И.В., Сухарев В.Г., Куликаускас В.С. Особенности импульсной полизэнергетической ионной имплантации	737
Сошиников И.П., Мурашов С., Шахмин А.Л., Ходорковский М.А., Берт Н.А. Распыление силицидов ванадия, молибдена и тантала низкоэнергетическими ионами Ar ⁺	741
Татаринов В.И., Матюшин В.М. Влияние атомарного водорода на структуру поликристаллических тонких пленок	743
Акишин А.И., Виргильев Ю.С., Черник В.Н. Экспериментальные исследования распыления углеродных материалов в потоке кислородной плазмы	747
Бондаренко Г.Г., Бонк О.Г., Кристя В.И., Прасицкий В.В., Хабибулин Р.И. Влияние переосаждения распыленных атомов на динамику распределения их потока вдоль поверхности полого катода в тлеющем разряде	752
	829

Цыбин О.Ю., Мишин М.В. Состав ионного потока в источнике с импульсным разрядом по поверхности диэлектрика	756
Эпельфельд А.В., Людин В.Б., Дунькин О.Н., Невская О.С. Характер разряда в системе металла–оксид–электролит при микродуговом оксидировании на переменном токе	759
Суминов И.В., Эпельфельд А.В., Борисов А.М., Людин В.Б., Романовский Е.А., Беспалова О.В., Куликаускас В.С., Дунькин О.Н., Семенов С.В. Синтез керамикоподобных покрытий при плазменно-электролитической обработке вентильных металлов	763
Дробич В.Г. Модельные гамильтонианы системы "металл–движущийся атом"	767
Евстифеев В.В., Костица Н.В. О зеркальном отражении ионов от поверхности в области низких энергий.....	771
Маринюк В.В., Ремизович В.С. Использование принципа инвариантности в теории распыления аморфных и поликристаллических материалов	777
Гусаров И.А., Коровушкин А.В., Осадчиеv В.М. Перестройка позитронной квазичастицы при взаимодействии позитрона с поверхностью металла	782
Усман Е.Ю., Матулевич Ю.Т. Поведение электронной подсистемы твердого тела в каскаде столкновений. Динамика электронной температуры	787
Бер Б.Я., Журкин Е.Е., Кудрявцев Ю.А., Куликов Д.В., Трушин Ю.В., Харламов В.С. Ионное моделирование GaAs-гетероструктур: эксперимент и компьютерное моделирование	791
Аntonов Н.В., Корниенко С.Н., Литиновский А.М., Петров В.Б., Плещаков А.С., Хрипунов Б.И., Шапкин В.В. Углеродные материалы в стационарном потоке дейтериевой плазмы	796
Лозован А.А., Митин Б.С. Влияние ионной имплантации на смачиваемость углеграфитовых материалов расплавами меди и Nb ₂ O ₅	801
Джурахалов А.А., Кутлиев У.О., Хафизов И.И. Перефокусировка потока рассеянных ионов и распыление поверхности GaP(100) при скользящем падении	805
Маланов К.А., Светцов В.И., Менагаришивили С.Д. Закономерности травления графита на катоде в области положительного столба и послесвечения тлеющего разряда в кислороде	811
Алексеев Ю.А., Гурович Б.А., Домантовский А.Г., Казеев М.Н., Приходько К.Е. Использование мощных импульсных плазменных потоков для технологических целей	814
Самойлов В.Н., Корсакова О.С., Елесин В.А. Механизмы образования угловых распределений атомов, распыленных с граней (001) и (111) Ni	821
Юрасова В.Е. XIV международная конференция "Взаимодействие ионов с поверхностью" (ВИП-99)	827